■走査電子顕微鏡

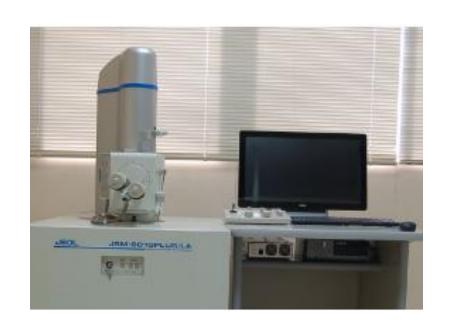
【用途】金属、セラミック、プラスチック製品等の生産工程、及び客先、市場で付いた傷や破断面を高倍率で<u>観察</u>し原因特定に活用できます。

【型式】日本電子(株) JSM-6010PLUS/LA

【仕様他】

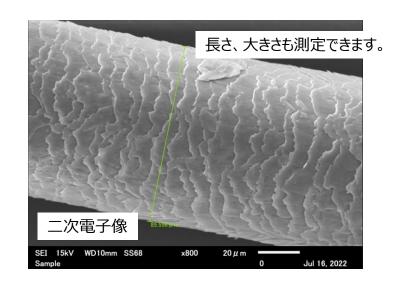
- •倍率:5~30万倍
- •2次電子分解能: 4.0nm
- 最大試料サイズ: Φ32mm、高さ48mm以下
- •加速電圧:~30kV

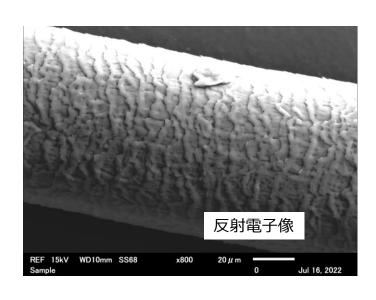
【設置年】 2015(H27)年



■走査電子顕微鏡

走査電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope)は電子顕微鏡の一種で、電子線を絞って電子ビームとして対象に照射し、対象物から放出される二次電子、反射電子(後方散乱電子、BSE)、透過電子、X線、カソードルミネッセンス(蛍光)、内部起電力等を検出する事で対象を観察します。





■走査電子顕微鏡+EDS

観察する試料により分析前処理が必要な場合があります。 分析前処理に必要な機器も用意しております(有料)。



導電性が無い試料 の分析を行うため Pt -Pdコートします。



汚れた試料を洗浄 します。

イオンスパッター

超音波洗浄器